DERWENT-1981-03784D

ACC-NO:

198104 DERWENT-

WEEK:

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Optical waveguide fibre with low attenuation - where

desired profile of refractive index is obtd. by diffusing

000

gas, esp. argon, into vitreous silica fibre

INVENTOR: SCHNEIDER, H

PATENT-ASSIGNEE: SIEMENS AG[SIEI]

PRIORITY-DATA: 1978DE-2843333 (October 4, 1978)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC DE 2843333 A January 15, 1981 N/A N/A

DE 2843333 C September 22, 1983 N/A 000 N/A

INT-CL (IPC): G02B005/14

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 2843333A

BASIC-ABSTRACT:

The fibre has a refractive index(RI) which decreases continuously in the radial direction. The fibre is made from a homogeneous fibre into which a polarisable qas(I) is diffused via high temps. and pressures, the gas being soluble in the fibre and providing the required RI profile.

The fibre is pref. vitreous silica, whereas gas(I) is pref. a noble gas; oxygen; N2; H2; HCl; halogen; water; ammonia, or a corresp. deuterium cpd.; CO; or NO. The gas can be diffused into the fibre before, during, or after drawing, and the concn. of the gas near the periphery of the fibre can be reduced by allowing some gas to diffuse out of the fibre, esp. in an atmos. of krypton.

An accurate RI profile can be simply obtd. without the danger of impurities contaminating the fibre.

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 2843333C

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

The fibre has a refractive index(RI) which decreases continuously in the radial direction. The fibre is made from a homogeneous fibre into which a polarisable gas(I) is diffused via high temps. and pressures, the gas being soluble in the fibre and providing the required RI profile.

The fibre is pref. vitreous silica, whereas gas(I) is pref. a noble gas; oxygen; N2;H2;HCl; halogen; water; ammonia, or a corresp.

deuterium cpd.; CO; or NO. The gas can be diffused into the fibre before, during, or after drawing, and the concn. of the gas near the periphery of the fibre can be reduced by allowing some gas to diffuse out of the fibre, esp. in an atmos. of krypton.

An accurate RI profile can be simply obtd. without the danger of impurities contaminating the fibre.

DERWENT-CLASS: F01 L01 P81 V07

CPI-CODES: F01-C; F01-D09; F01-E01; F04-G; L01-F03; L01-L05;

EPI-CODES: V07-A03; V07-F01A1;

⑤

19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



28 43 333 Offenlegungsschrift

0 **Ø**

Aktenzeichen:

P 28 43 333.2-51

G 02 B 5/14

0

Anmeldetag:

4. 10. 78

€

Offenlegungstag:

15. 1.81

30

Unionspriorität:

Bezeichnung:

29 33 39

(54)

Lichtwellenleiter

1

Anmelder:

Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München

0

Erfinder:

Schneider, Hartmut, Dipl.-Chem. Dr.rer.nat., 8000 München

Prüfungsantrag gem. § 28b PatG ist gestellt

© 12.80 030 063/3

- 1 - VPA 78 P 7 166 BRD

Patentansprüche

20

30

- Lichtwellenleiter aus einer extinktionsarmen
 Faser mit in radialer Richtung kontinuierlich abnehmender Brechzahl, dadurch gekennzeichnet, daß in einem homogenen Fasermaterial ein polarisierbares, im Fasermaterial
 lösliches, bei hohen Temperaturen und Drucken
 diffusionsfähiges Gas mit einem dem angestrebten
 Brechzahlprofil entsprechenden Konzentrationsverlauf gelöst ist.
- Lichtwellenleiter nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Fasermaterial
 Quarzglas ist.
 - 3. Lichtwellenleiter nach Anspruch 1 oder 2, da-durch gekennzeichnet, daß das Gas ein Edelgas, Stickstoff oder Sauerstoff ist.
- 4. Lichtwellenleiter nach Anspruch 1 oder 2, da-durch gekennzeichnet, daß das Gas Wasserstoff, Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff, ein Halogen, Wasser, Ammoniak oder eine entsprechende deuterierte Verbindung ist.
 - 5. Lichtwellenleiter nach Anspruch 1 oder 2, da-durch gekennzeichnet, daß das Gas Kohlenmonoxid oder Stickstoffmonoxid ist.
- 6. Verfahren zur Herstellung eines Lichtwellenleiters nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dad urch gekennzeich eine t, daß aus einem extinktionsarmen Fasermaterial eine Faser gezogen wird, daß das Fasermaterial vor, während oder nach

· 030063/0003

2843333

- 2 - VPA 78 P 7 166 BRD

dem Ziehen mit dem Gas angereichert wird, und daß die Gaskonzentration in den Randbereichen der gezogenen Faser durch Ausdiffundieren des Gases bei hohen Temperaturen und hohen Drucken gesenkt wird.

- Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich net, daß zur Anreicherung
 des Fasermaterials das Gas aus einer Hochdruckatmosphäre bei Temperaturen knapp unterhalb der Erweichungstemperatur des Fasermaterials eindiffundiert
 wird.
- 8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dad urch
 15 gekennzeich net, daß das Ausdiffundieren
 in einer Schutzgasatmosphäre aus einem schlechter
 diffundierenden Gas durchgeführt wird.
- 9. Verfahren nach Anspruch 7 und Anspruch 8, da 20 durch gekennzeichnet, daß als eindiffundierendes Gas Argon und als Schutzgas Krypton verwendet wird.
- 10. Verfahren zum Herstellen eines Lichtwellenleiters
 25 nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
 gekennzeich net, daß ein Quarzglasrohr innen mit dem Gas gefüllt und das gefüllte Rohr
 zu einer Faser ausgezogen wird.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Berlin und München

Unser Zeichen VPA 78 P 7 166 BRD

5 Lichtwellenleiter

Die Erfindung betrifft einen Lichtwellenleiter aus einer extinktionsarmen Faser mit in radialer Richtung kontinuierlich abnehmender Brechzahl (Gradienten-10 faser).

Ein bekanntes Verfahren zum Herstellen von Gradientenfasern ist das Doppeltiegel-Verfahren, bei dem aus
einem mit einem hochtransparenten Material z.B. Bleisilikatglas gefüllten ersten Tiegel mittels einer
ersten Düse ein Faserkern ausgezogen wird. In einem
zweiten Tiegel befindet sich eine andere Materialschmelze (z.B. Glas niedrigerer Brechzahl), um die
Faser bereits während des Ausziehens mittels einer
konzentrischen Ringdüse mit einem Mantel zu umgeben.
Durch Interdiffusion des Kernglases und des Mantelglases ergibt sich ein kontinuierlicher Übergang
der Materialzusammensetzung und der Brechzahl. Das

Kbl 2 Hag / 29.9.1978

- Z - VPA 78 P 7 1 6 6 BRD

Verfahren kann zur Produktion großer Fasermengen verwendet werden, jedoch finden sich häufig Verunreinigungen, die von den Tiegeln in die Faser eingeschleppt werden und zu Lichtverlusten führen.

Das Verfahren ist auf die Herstellung von Multikomponenten-Glasfasern mit rasch diffundierenden Glasbestandteilen beschränkt.

Haufig wird auch das CVD (Chemical Vapour Deposition)-10 Verfahren angewendet, bei dem ein Quarzglasrohr auf der Innenseite mit synthetischen, durch Gasphasenreaktion gewonnenen Glas beschichtet wird und das mehrfach beschichtete Rohr zu einer Faser ausgezogen wird. Als reaktionsfähiges Glas wird häufig eine 15 Mischung von SiCl₄, GeCl₄ und 0₂ verwendet, die zu SiO2-GeO2-Glas reagiert. Die GeO2-Zugabe bewirkt eine Brechzahlerhöhung des abgeschiedenen Glases gegenüber dem Quarzglasrohr, wodurch die Lichtwellenleitung in der Faser gewährleistet wird. Man erhält 20 also eine Faser mit radialer Schichtung. Diese Fasern besitzen zwar im allgemeinen gute Übertragungseigenschaften für Lichtsignale, jedoch ist es nachteilig, daß das Verfahren intermittierend betrieben wird und daher sowohl zu periodischen als auch zu 25 unregelmäßigen Brechzahlprofilschwankungen führen kann.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen neuen Typ von Gradientenfasern zur Verfügung zu 30 stellen, der einfach herzustellen ist und bei dem die Gefahr von Verunreinigungen und von Brechzahlprofilschwankungen verringert ist.

Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Lichtwellen-35 leiter, bei dem in einem homogenen Fasermaterial ein

- 78 P 7 1 6 6 BRD

polarisierbares, im Fasermaterial lösliches, bei hohen Drucken diffusionsfähiges Gas mit einem dem angestrebten Brechzahlprofil entsprechenden Konzentrationsverlauf gelöst ist.

5

Als ein bevorzugtes Fasermaterial sei Quarzglas betrachtet. Im Glasnetzwerk sind freie Gitterplätze enthalten, in die Gasmoleküle eingebaut werden können. Entsprechend der Lorenz-Lorentz'schen Gleichung

10

$$\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} = \frac{4 \, \Re}{3} \, (\, \lambda_1 N_1 - \, \lambda_2 N_2)$$

kann die Brechzahl n berechnet werden, wenn in das

SiO₂-Gitter (N₁ und d₁ seien die Teilchendichte
und die Polarisierbarkeit von SiO₂) polarisierbare
Moleküle (Teilchendichte N₂, Polarisierbarkeit d₂)
eingebaut werden. So ergibt sich z.B. für Quarzglas
(d₁ = 2,952 Å³) und Argon (d₂ = 1,443 Å³) bei
einer Konzentration von 2 Mol.-% Argon eine Brechzahl n = 1,4633 gegenüber der Brechzahl des Quarzglases von 1,4585. Die numerische Apertur einer
entsprechenden, ummantelten Faser beträgt dann 0,12.
Bei 1 Mol.-% Argon beträgt die numerische Apertur

25 0,08.

Die Löslichkeit vieler ein- und zweiatomiger Gase, z.B. Edelgase, H₂, O₂ oder N₂, in Glas wächst bis zu hohen Drucken linear mit dem Gasdruck und führt bei Drucken über etwa 1 kb zu einer Sättigung. Der Löslichkeitskoeffizient C₁/C_g (das Verhältnis der gelösten Gaskonzentration C₁ zur Konzentration C_g in der Gasatmosphäre) wurde experimentell zu 0,024 (Helium) bzw. 0,019 (Neon) bzw. 0,03 (Wasserstoff) bzw. 0,01 (Argon oder Sauerstoff) bestimmt.

-4- VPA 78 P 7 166 BRD

Die Gesamtzahl der im Quarzglas verfügbaren Zwischengitterplätze kann bei diesen Gasen zu

1 bis 3 x 10²¹ cm⁻³ angegeben werden. Dies entspricht einer Löcherkonzentration von 4 bis 12 Mol.-%,

5 d.h. pro SiO₂-Formeleinheit stehen 1/15 bis 1/7 freie Gitterplätze zur Verfügung. Experimentell konnte bei 850 Atmosphären eine Wasserstoff-Molekülkonzentration von 6 x 10²⁰ cm⁻³ (entsprechend 2,6 Mol.-%) und eine Neon-Atomkonzentration von 3,5 x 10²⁰ cm⁻³ (entsprechend 1,6 Mol.-%) im Quarzglas gefunden werden. Für Argon wurde in Quarzglas bei 2 kb und 650°C etwa 1 Mol.-% und in einem Glas der Zusammensetzung K₂0.4SiO₂ bei 10 kb und 800°C etwa 7 Mol.-% Lös-lichkeit gefunden.

15

Daraus ergibt sich die Möglichkeit, im Faserkern durch Lösen erheblicher Gasmengen die Brechzahl gegenüber einem Fasermantel, in dem keine Gase gelöst sind, zu erhöhen. Hierfür kommen nicht nur die bereits erwähnten Gase infrage, die physikalisch gelöst werden, vielmehr können auch Gase wie Wasserstoff, Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff, Halogene, Wasser und Ammoniak einschließlich der korrespondierenden deuterierten Verbindungen verwendet werden, deren Löslichkeit teilweise auf reversiblen chemischen Vorgängen beruht. Auch Kohlenmonoxid und Stickstoffmonoxid bei hohen Temperaturen sind geeignet.

Der Lichtwellenleiter gemäß der Erfindung kann hergestellt werden, indem aus einem mit den genannten Gasen
gesättigten Fasermaterial eine Faser gezogen wird
und anschließend in den Randbereichen der gezogenen
Faser die Gaskonzentration gesenkt wird. Man kann
aber auch den gesättigten Faserkern herstellen, indem
das Fasermaterial während oder nach dem Ziehen mit

- 5 - VPA 78 P 7 166 BRD

Gas gesättigt wird. Zum Einstellen des Konzentrationsprofils kann man sich dabei vorteilhaft der Diffusionsvorgänge bedienen, die stark druck- und temperaturabhängig sind. So beträgt der Diffusionskoeffizient 5 von Neon in Quarzglas bei 1000°C den relativ hohen Wert von 2,5 x 10^{-6} cm² (Argon: 1,4 x 10^{-9} cm² sec⁻¹) und bei 25° C nur noch 5×10^{-12} cm² sec⁻¹ (Argon: 5×10^{-25} cm² sec⁻¹). Für 1 /um Diffusionsstrecke sind demnach für Argon bei 1000°C etwa 1 sec er-10 forderlich, bei 25°C jedoch etwa 10⁸ Jahre. Aus einer mit dem Gas gesättigten Faser kann demnach bei hohen Temperaturen durch Ausdiffundieren aus den Randbereichen der Faser die Gaskonzentration im Fasermantel während der Herstellung erniedrigt wer-15 den, das dadurch erreichte Konzentrationsprofil bleibt aber nach Abkühlung der Faser auf Normaltemperaturen über lange Zeiten hinweg bestehen. Da durch die gelösten Gase der Binnendruck im Fasermaterial erheblich ansteigt, ist es vorteilhaft, während des 20 Ausdiffundierens und Abkühlens einen hohen Außendruck aufrechtzuerhalten, um eine Bläschenbildung zu vermeiden.

Auch das Einbringen der Gase in das Fasermaterial kann vorteilhaft durch Diffusion erfolgen, wobei das Fasermaterial in einer Hochdruckatmosphäre des Gases bei Temperaturen knapp unterhalb der Erweichungstemperatur des Fasermaterials mit dem Gas angereichert wird. Die Anreicherung kann entsprechend den verwendeten Drucken und Diffusionsdauern bis nahe an die Sättigung getrieben werden. Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn beim Ausdiffundieren die während der Anreicherung verwendete Hochdruckatmosphäre des diffusionsfähigen Gases durch eine Schutzgasatmosphäre aus einem schlechter diffundierenden Gas ausgetauscht wird.

- F - VPA 78 P 7 1 6 6 BRD

Man kann einen Lichtwellenleiter nach der Erfindung aber auch auf andere Weise herstellen. So kann vorteilhaft ein Glasrohr innen mit dem polarisierbaren, löslichen Gas gefüllt werden und das gefüllte Rohr anschließend zu einer Faser ausgezogen werden. Während des Ausziehens diffundiert das Gas der Rohrfüllung an der Rohrinnenseite in das Fasermaterial, ohne daß eine gleichmäßige Gaskonzentration bis an die Rohraußenwand entstehen würde. Die aus dem Rohr ausgezogene Faser enthält dann nur im Kern eine hohe Gaskonzentration, während der Mantel praktisch gasfrei ist.

Auf diese Weise können Lichtwellenleiter üblicher 15 Dicke, z.B. 50 bis 500 /u Durchmesser, hergestellt werden, die hinsichtlich ihres Brechzahlprofils und der numerischen Apertur mit Lichtwellenleitern, die auf herkömmliche Weise erzeugt werden, vergleichbar sind. Da diese Fasern aus einem homogenen hoch-20 transparenten (extinktionsarmen) Material hergestellt sind und die Brechzahländerung lediglich durch die Konzentrationsänderung des gelösten Gases hervorgerufen wird, besteht bei diesen Fasern nur eine geringe Gefahr von Verunreinigungen und Brechzahl-25 schwankungen, wie sie z.B. beim Doppeltiegel-Verfahren auftreten. Das Herstellungsverfahren erfordert ferner nur einen geringen Aufwand und kann z.B. beim Ausziehen eines Rohres kontinuierlich mit hohen Arbeitsgeschwindigkeiten erfolgen.

Anhand zweier Ausführungsbeispiele wird das Wesen der Erfindung näher erläutert.

Eine auf herkömmliche Weise hergestellte Quarzglas-35 faser mit etwa 100 /u Durchmesser wird in einem

30

- 2 - VPA 78 P 7 1 6 6 BRD

Autoklaven einer Argonatmosphäre von etwa 1000 bar bei 900°C über eine Stunde ausgesetzt. Dabei können Argonkonzentrationen von etwa 1 Mol.-% erreicht werden. Durch Erhöhung des Druckes (2 bis 3 kb) und 1ängere Diffusionsdauern sind auch höhere Argonkonzentrationen (z.B. 2 Mol.-%) erreichbar. Anschließend wird im Autoklaven die Argonatmosphäre durch eine Krypton-Atmosphäre gleichen Druckes und gleicher Temperatur ersetzt. Nach 20 Minuten wird der Autoklav abgekühlt und die fertige Faser entnommen.

Die Diffusion von Krypton verläuft wesentlich langsamer als bei Argon. Daher ist in der Krypton-Atmosphäre

15 das Argon aus den Randbereichen der Faser ausdiffundiert, während nur geringe Kryptonmengen eindiffundiert sind, so daß das gewünschte Konzentrationsprofil und somit das erforderliche Brechzahlprofil hergestellt ist. Die geringe Eindiffusion von Krypton bewirkt dabei zusätzlich eine erwünschte Erhöhung der Zugfestigkeit der Faser.

In einem anderen bevorzugten Ausführungsbeispiel wird ein Quarzrohr mit 8 mm Innendurchmesser und 10 mm Außendurchmesser bei einem Druck von einigen kb und Temperaturen zwischen 800 und 900° mit Argon gefüllt. Anschließend wird das Rohr auf bekannte Weise zur Faser ausgezogen. Während des Ziehens diffundiert das Argon in die Innenbereiche des Rohres und es entsteht in der gezogenen Faser ein mit Argon angereichter Kern, während die äußeren Bereiche praktisch gasfrei sind.

10 Patentansprüche

VPA 78 P 7 166 BRD

Zusammenfassung

Lichtwellenleiter

werden.

Die Erfindung betrifft einen Lichtwellenleiter mit kontinuierlich nach außen abnehmender Brechzahl (Gradientenfaser). Erfindungsgemäß ist in einem homogenen Fasermaterial ein polarisierbares Gas mit einem dem angestrebten Brechzahlprofil entsprechenden Konzentrationsverlauf gelöst. Zur Herstellung wird eine Faser mit dem Gas angereichert (z.B. durch Diffusion bei hoher Temperatur und hohem Druck) und im Mantel das Gas anschließend durch Ausdiffundieren entfernt. Es kann auch ein Rohr mit dem Gas innen gefüllt und anschließend zur Faser ausgezogen